

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成23年4月21日(2011.4.21)

【公開番号】特開2010-232195(P2010-232195A)

【公開日】平成22年10月14日(2010.10.14)

【年通号数】公開・登録公報2010-041

【出願番号】特願2010-156306(P2010-156306)

【国際特許分類】

H 01 J 37/317 (2006.01)

H 01 J 37/20 (2006.01)

【F I】

H 01 J 37/317 D

H 01 J 37/20 A

【手続補正書】

【提出日】平成23年3月7日(2011.3.7)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

集束イオンビーム光学系と、当該集束イオンビーム光学系とビーム軸同士が交差するように配置された電子ビーム光学系と、試料を載置する試料台をその内部に有する真空試料室と、を備えた微小試料加工観察装置に搭載できる移送手段であって、

イオンビームの照射により試料から分離された微小試料を支持するプローブを有し、前記真空試料室の内部において当該プローブを回転させて前記微小試料の姿勢を制御するように構成された移送手段。